多目的 X 線分光計測装置の製作

仕様書

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

目　的

本仕様書は国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 「水素利用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業」に係る委託事業におけるビームライン技術開発において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）が運営する NanoTerasu のビームラインに接続し、超高真空下で表面処理を行った試料を大気非曝露で X 線分光計測を行う装置の製作に関するものである。本仕様書の範囲には、真空機器等の設計、製作、組立等が含まれる。

1. 仕様

1.1. 構成

(1) 測定チャンバー　1 台
(2) 排気チャンバー　1 台
(3) 4 軸サンプルステージ　1 式
(4) 真空排気及び取付機器　1 式
(5) 電源組込型 XY 位置調整架台ユニット　1 式
(6) 共通仕様

1.2. 仕様事項

(1) 測定チャンバー

a) チャンバーの材質は SUS304 とし、電解研磨による表面処理を施すこと。
b) 次のポート等を設けること。
①チャンバー中心からフランジまでの距離が 130mm の ICF70×7 ポート。
②チャンバー中心からフランジまでの距離が 140mm の ICF114×1 ポート。
③上下方向に配置された面間距離が 250mm の ICF152×2 ポート。
④斜めからチャンバー中心を向いたサンプルを目視できる ICF70×4 ポート。
⑤別途協議の上指示するポート。
⑥ポート長については、協議の上、軽微な変更に対応すること。
c) チャンバー内径は φ196mm 程度とするが、別途協議の上指示する内径とすること。
d) 各ポートは、放射状及び斜めにチャンバー中心に向かって配置されること。
e) 以下のフランジを備えること。
①内部目視確認用のビューポートフランジ ICF70×4。
②機器接続以外のポートにはブランクフランジ。
③フランジには各種機器取付用のボルト等を付属する。
f) ICF152 ポートの片側は回転フランジとすること。
h) 特記事項
各種機器との取り合いが確認できる 3D モデルを受注者が準備し、詳細な寸法や配置については別途協議のうえ決定する。

取付機器の 3D データが存在しない機器については受注者が採寸などを行い模式 3D データを準備する。

(2)　排気チャンバー

a)　チャンバーの材質は SUS304 とし、電解研磨による表面処理を施すこと。

b)　次のポート等を設けること。

①チャンバー中心からフランジまでの距離が 130mm の ICF70×4 ポート。

③　チャンバー中心からフランジまでの距離が 140mm の ICF152×1 ポート。

③上下方向に配置された面間距離が 280mm の ICF152×2 ポート。

④別途協議の上指示するポート。

⑤ポート長については、協議の上、軽微な変更に対応すること。

c)　架台に対して十分な強度で締結できる構造を有すること。

d)　以下のフランジを備えること。

①機器接続以外のポートにはブランクフランジ。

②フランジには各種機器取付用のボルト等を付属する。

e)　特記事項

各種機器との取り合いが確認できる 3D モデルを受注者が準備し詳細な寸法や配置については別途協議のうえ決定する。

取付機器の 3D データが存在しない機器については受注者が採寸などを行い模式 3D データを準備する。

(3)　4 軸サンプルステージ

a)　4 軸（X,Y,Z, θ ）は 5 相ステッピングモーターにより制御駆動可能なこと。

b)　Z 軸ストローク範囲は 150mm とすること。

c)　Z 軸駆動範囲の任意の位置に 2 箇所の位置検出スイッチを設けること。

d)　溶接ベローズの有効内径は ϕ 70mm 以上とすること。

e)　XY 軸ストローク範囲は±12.5mm とすること。

f)　XY 軸駆動範囲の任意の位置に 2 箇所の位置検出スイッチを設けること。

g)　θ 軸は 0～360°回転が可能なこと。

h)　チャンバー取付フランジは ICF152 とし駆動フランジは ICF114 とすること。

i)　駆動フランジに取り付けたサンプルホルダーステージを設けること。

j)　参考図 1 のサンプルホルダー×5 枚を搭載できること。

k) サンプルホルダーステージは電位的に接地からフローティングさせ、その電位を同軸端子から取り出すことが可能なこと。

l)　真空を破らずにトランスファーロッドによりサンプルホルダーの受け渡しが可能なこと。

m)　横方向からのホルダー受け渡し時の応力に十分に耐えられる構造とすること。

(4)　真空排気及び取付機器

a)　ターボ分子ポンプは取付けフランジ ICF152、排気速度窒素:260L/sec 程度、圧縮比水素:9×10^5 程度の能力を有し（PFEIFFER:HiPace300 相当品）、スプリンターシールド（吸気口保護網）と空冷ファンを付属すること。

b)　ターボ分子ポンプ制御電源は多機能コントローラー（OmniControl300 相当品）とし真空計表示機を兼ねること。

c)　真空計はフルレンジコールドカソード（PFEIFFER:PKR361 相当品）としターボ分子ポンプ制御電源により表示することが可能なこと。

d)　各種機器は 3m以上のケーブルにより機関配線を接続することができること。

e)　粗びきポンプは、多段ルーツ型ドライポンプ（Kashiyama:NeoDry15G 相当品）とし到達圧力 1Pa 程度、排気速度 250L/min 程度の能力を有し、ガスバラストバルブ、アイソレートバルブ、大気開放型サイレンサーを備え、200V 仕様長さ 5m、引っかけプラグ仕様の電源ケーブルを付属すること。

f)　真空排気やモーター駆動に必要な配管部品類や電装部品類を準備すること。

g)　4 軸サンプルステージの θ ステージ差動排気配管及びステージ側バルブを準備すること。

h)　ターボ分子ポンプとチャンバー間には面間距離 70mm の手動 ICF152 ゲートバルブ（VAT:10840-CE01 相当品）を備えること。

i)　測定チャンバーには面間距離 35mm の手動 ICF70 ゲートバルブ（VAT:10836-CE01 相当品）×1 台を備えること。

j)　ターボ分子ポンプ排気口には NW25 手動高真空対応アングルバルブを備えること。

k)　4 軸サンプルステージのモーターを制御するための接続ケーブル（長さ 5m程度）、モータードライバー（メレック: H718-00/GD-5410 相当品）及びパルスコントローラを準備すること。

l)　上記パルスコントローラは、既存制御ソフトウェアと互換性を持たせるため、ツジ電子製 PM16C-16HW2 相当品とし、ハンドボックス（ツジ電子: PM16C-HDX16 相当品）を付属すること。

m)　SDD 検出器を搭載するための有効内径 ϕ70mm、ストローク範囲 100mm の手動 ICF114 中空 Z ステージを付属すること。

n)　上記の中空 Z ステージは駆動軸に対して溶接ベローズを挟んだ反対側にガイド軸を設けた構造とすること。

o)　特記事項

各種機器との取り合いが確認できる 3D モデルを受注者が準備し、詳細な寸法や配置については別途協議の上決定する。

(5)　電源組込型 XY 位置調整架台ユニット

a)　アルミフレーム構造とし十分な強度を有すること。

b)　可搬用のキャスター及び高さ調整アジャスターを備えていること。

c) 測定チャンバーの中心が床面から 1430mm±20mm の範囲以上で設置調整が可能な構造とすること。
d) 測定チャンバー及び排気チャンバーに取り付ける機器類が十分な空間を設けて取り付けが可能なこと。
e) ターボ分子ポンプをサポートする構造を有すること。
f) QST が所有する多目的計測チャンバーと接続することが可能な構造であり、接続した際にお互いの架台が干渉しない形状であること。
g) 機器を搭載しアンカー打設した状態で測定チャンバー類の位置調整を XY±20mm の範囲で調整可能な構造とすること。
h) 各種電源類を架台内部に搭載することが可能なこと。
i) 床固定が可能なアンカー打設用 L 字板等を備えていること。
j) 特記事項
各種機器との取り合いが確認できる 3D モデルを受注者が準備し、詳細な寸法や配置については別途協議の上決定する。

(6) 共通仕様
a) 真空シールを有する全ての機器において 1×10^{-10} Pa・m^3/s 以下のリークレートを達成すること。
b) 真空内部に使用する部材の全ては、超高真空に適合する部材を使用すること。
c) その他特に記載のない事項については、「次世代放射光施設ビームライン機器共通事項」を原則遵守すること。

2. 納入場所
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 468-1
NanoTerasu 内の指定する場所

3. 納入条件
上記納入場所に納入後、担当者の指示する場所に設置すること。
必要に応じアンカー打設に対応すること。

4. 納入期限
令和 9 年 3 月 12 日（金）

5. 検査条件
5.1. 出荷前検査
① サンプル導通試験検査及びステージモーター駆動検査を行い、QST が合格と認めること。

② 真空計測チャンバーへ所定の機器を取り付けた状態で残留ガスを Q-Mass により 1～410amu の測定を行い、QST が合格と認めること。
計測に使用する機器は、受注者の準備とする。

5.2. 納入時検査

第 2 項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査を行い、QST が合格と認めること。
提出図書の確認を行い、QST が合格と認めること。

6. 提出図書

図書名	提出時期	部数
確認図	製作開始前	1
完成図面	納入時	1
検査成績書	納入時	1

（提出場所）
QST　NanoTerasu センター
高輝度放射光研究開発部　ビームライングループ

6.1. 印刷物

a) 完成図面を印刷物として提出すること。
b) 使用する言語は日本語とする。ただし、海外機器等の取扱説明書等はこの限りでない。
c) 印刷物は、原則 A4 サイズ用紙で提出すること。ただし、図表等はこの限りでない。
d) 印刷物は、原則チューブファイル等で綴じて提出すること。ただし、冊子体の場合又は頁数の少ない場合はこの限りでない。
e) 大型図面は折りたたんで収納すること。縮小図は可とするが、文字が判読できること。

6.2. 電子ファイル

a) 完成図面に関しては、2D 図面を pdf ファイルと dxf ファイルで提出し、また 3D 図面を SOLIDWORKS 可読形式ファイルで提出すること。
b) 各機器の取扱説明書が電子ファイルとして提供されている場合には併せて提出すること。
c) 提出図書の作成に使用するソフトウェアは最新バージョンを用いることが望ましい。
d) 特記事項
CAD ファイルは周辺機器との干渉や取り合い等の確認に供するためにその使用を制限した上で他社と共有する場合がある。この点を考慮し CAD ファイルを提出すること。

7. 支給品

なし

8. 知的財産権

知的財産権については、知的財産権特約条項のとおりとする。

9. 機密保持

受注者は、本品の製作にあたり、発注者から知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。ただし、あらかじめ量研担当者の了承を得た場合にはこの限りでない。

10. 契約不適合責任

契約不適合責任については契約条項のとおりとする。

11. グリーン購入法の推進

a) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適合する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。

b) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

12. 協議事項

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合、QST と協議のうえ、その決定に従うものとする。

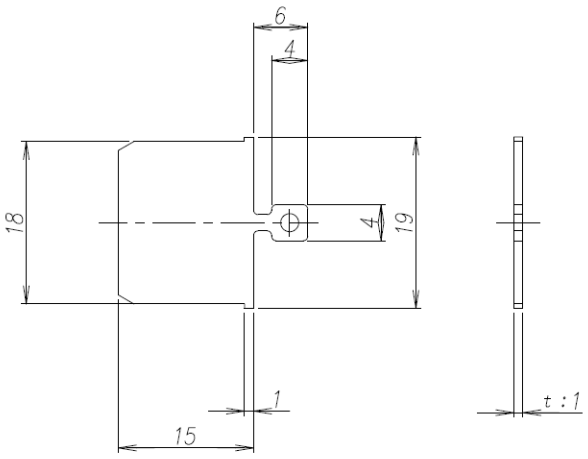
13. 特記事項

受注者は、本仕様書に関する前提事項として「次世代放射光施設ビームライン機器共通事項」を原則遵守すること。ただし、別途指示等が本仕様書に明記されている場合にはそれに従うこと。

（要求者）

部課（室）名： NanoTerasu センター
高輝度放射光研究開発部　ビームライングループ

氏　　名： 堀場　弘司



参考図１　サンプルホルダーの図面

次世代放射光施設ビームライン機器
共通事項

第 2 版（Ver. 2.1）

2022 年 4 月

本稿は、当該放射光施設のビームラインにおいて使用する機器（持ち込み装置を含む）に求める共通の仕様についてまとめたものである。ビームライン光学系機器やエンドステーションの機器に適応される。

1.　各種定義

1.1.　座標軸の定義

・ビームライン機器の座標軸を次のように定義する。光源から試料位置に対して、図１のように図を描いたときに重力の働く方向をｙ軸マイナス方向として座標軸（右手系）を定義する。

・光学素子の回転軸は、光学素子の中心を原点（光学素子原点）として、光学素子表面の法線方向の軸と光軸との関係から、図２のように回転軸を定義する。

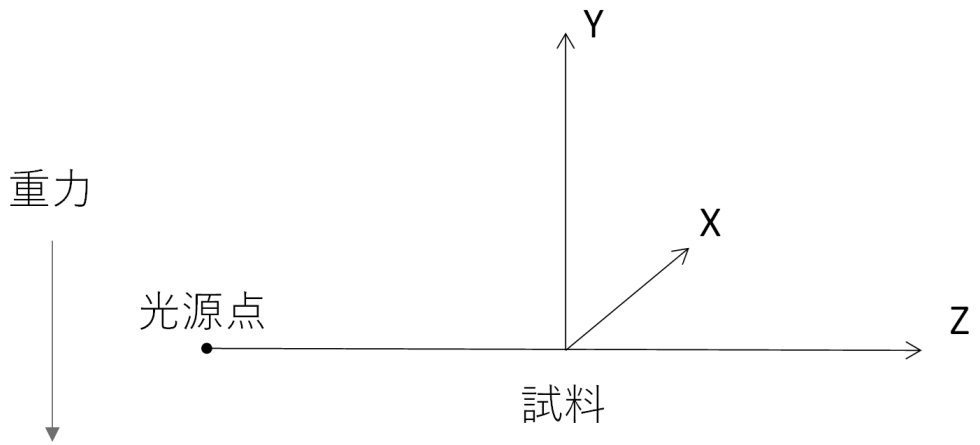


図１　座標軸の定義

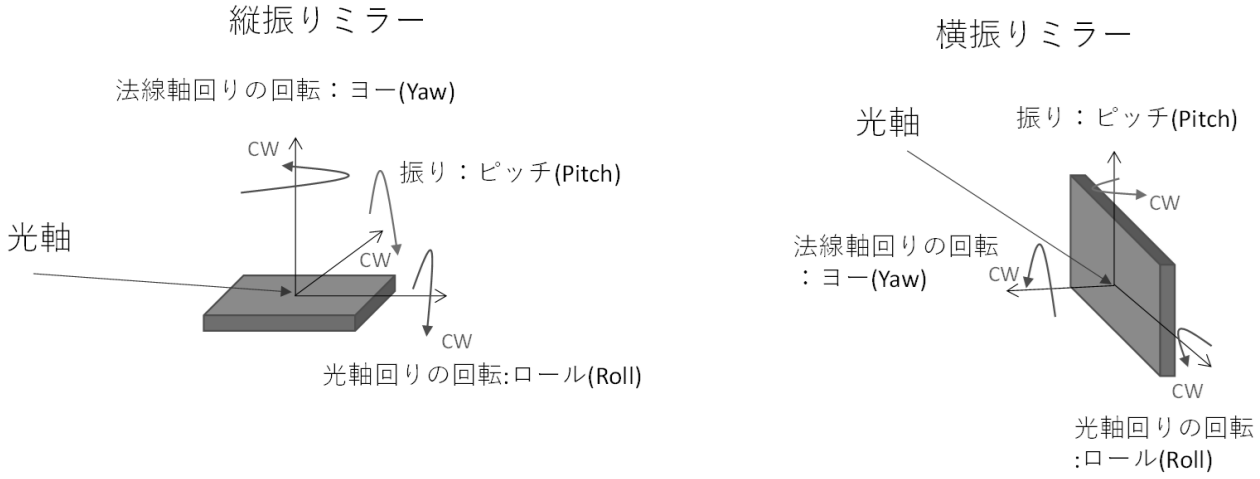


図２　座標回転軸の定義

1.2. 原点の定義

・挿入光源の上下流に設置された四重極電磁石の中点をビームラインの原点とする（ビームライン原点）。

・光学素子の位置決め等を行う場合は各々の光学素子の表面の中心を原点とする（光学素子原点）。

1.3. MKSA 単位系の使用

・完成図書を作成するにあたって、数値の単位は MKSA 単位系を使用すること。

・温度の単位はセルシウス度（℃）あるいはケルビン（K）を使用すること。

1.4. ビームラインの呼称

・ビームラインの名称は、ビームトランスポートトンネルを基準として、反時計回りにむけて番号が増加していく 2 桁のアラビア数字の後ろに挿入光源の場合は U、ウィグラーの場合は W を付して表記する。（例：BL01W）

1.5. 図面上の上流の位置

・完成図書の図面などを作成する場合、図表上の左側を光源点（ビームラインの原点）側とする。

1.6. 基準とする規格

・特に断らない限り、以下の規格ならびに基準に準拠して設計・施工を行い、図書を作成すること。

- 建築学会（建築工事標準仕様書）。
- 国土交通大臣官房長営繕部（機械設備工事共通仕様書）。
- 国土交通大臣官房長営繕部（電気設備工事共通仕様書）。
- 経済産業省（電気設備技術基準）。
- 日本電気協会内線規定。
- 建築基準法施行令。
- 日本工業規格（JIS）。
- 使用部品メーカー標準規格。

・他に指定が無い限り JIS 規格と同等以上の規格製品を用い、JIS 以外の製品を用いるときは予め許可を申し出ること。

2. 施設による境界条件

2.1. 実験ホールのスペース

2.1.1. ビームライン境界

・実験ホール外周部のイクスパンションジョイントの内側がビームライン機器を設置可能なエリアである。

・原則として、QST およびパートナー側で取り決めたビームライン境界の内側にすべてのビームライン機器が設置されること。

2.1.2.　通路の確保

・ビームライン機器を配置する際には近隣の装置と十分に間隔をあけて、機器を操作する者が通行できるための十分なスペースを確保すること。

放射線管理区域について

・実験ホール内の一部に第 2 種放射線管理区域が設定されている。工事関係者が放射線管理区域に立ち入る場合は、あらかじめ所定の手続きを行った上で作業を行うこと。

2.2.　実験ホールの床

2.2.1.　床耐荷重

・実験ホール内の床耐荷重は 2 t/m^2 である。この点に留意して設計施工すること。

2.2.2.　アンカー固定

・床目地のひび割れ防止用の切込み部分を避ける必要があるため、アンカー固定の場所はあらかじめ確認すること。

2.2.3.　光軸高さ

・放射光ビームの光軸高さは、実験ホール床面から 1400mm が設計値であるが、実験ホール床は理想的な平面ではなく、全面で±10mm 以内の起伏がある。

・ビームライン光学系の光軸は、設置位置における床面からの高さではなく、あくまで放射光ビームの高さが基準であることに留意すること。

2.3.　実験ホールの環境

2.3.1.　温度

・実験ホール内の温度は 25℃±2℃に設定されている。

2.3.2.　湿度

・実験ホール内の湿度は 50%±10%に設定されている。

2.3.3.　清浄度

・実験ホール内は光学素子や真空部品などを取り扱う場所となっている。そのため粉塵などがホール内に循環しないよう高い清浄度を保つことが求められることから、機器の設置およびその後の運用において、実験ホール内の環境を著しく乱してはならない。

・作業上、粉塵等が発生など実験ホール内の環境を著しく乱す可能性がある場合は、あらかじめ元の環境を乱さないような措置を講じること。

2.3.4.　振動・騒音

・実験ホール内には、実験試料ステージに nm レベルの空間分解能を有する実験装置が設置される。そのため振動や騒音の元となる機器の設置は極力避けること。あるいは振動や騒音の元となる機器を設置する場合は、防振・防音措置を講じること。

2.4.　実験ホールユーティリティ

・ビームライン設置場所に用意されるユーティリティーを表1に示す。
・想定される用途を考慮して、各ユーティリティーの取り合いは、放射光取り出しポート近くの収納壁ラチェット部もしくは実験ホール外周部のいずれかに設けられる。

表1　ビームラインに用意されるユーティリティー

設備	仕様	場所
分電盤	1Φ3W 210 V/105 V： 150A×2、100A×3、 20A×2（インターロック用） 3Φ3W 210 V： 100A×4、75A×3	収納壁ラチェット上部
圧縮空気用フランジ	0.7-0.85 MPa	収納壁ラチェット上部
循環冷却水用フランジ	70L/min、25℃±0.2℃	収納壁ラチェット上部
ヘリウム回収ライン	25Φ×1	実験ホール外周上部
液体窒素供給ライン	60Φ×2	収納壁ラチェット上部
排水口	25A×1（一般廃水）	実験ホール外周床
接地端子	A種接地接続 38sq 線 2BL につき1か所	実験ホール外周床

2.5.　電場
・実験ホール内では微弱な電気信号を検出する機器が多く設置されている。これらの機器のノイズ源となるような電場が発生する可能性がある装置を設置する場合はノイズを低減させるような措置を講じること。

2.6.　磁場
・実験ホール内に磁場を発生する装置を設置する場合、その磁場は放射光の光源性能の著しい低下を起こさない、且つ安定な運転を妨げない範囲に制限される必要がある。また実験者が立ち入る区域では磁場強度を 0.5mT 以下に抑えるような措置を講じるか、これを超える区域に立ち入り制限を施すこと。

3.　互換性の確保
3.1.　電気・制御
3.1.1.　ケーブル
・配線は原則としてエコケーブル（EM ケーブル）あるいは、電気用品安全法の耐燃性（JISC3005）傾斜試験に適合したケーブルを使用すること。
・複数の信号線を接続する場合は、原則としてモレックスやメイテンロックなどのコネクタ

を使用すること。
・ピンをコネクタに接続する際は、専用の工具を用いて接続を行うこと。
3.1.2.　電源コネクタ
・電源コネクタは分電盤のコネクタ形状にあったコネクタを使用すること。
・引掛タイプのコネクタを用いない場合は、トラッキング防止策を講じること。
・動力系統の電源には、過電流運転を防止するため、適切な容量の保護回路を設けること。さらに、漏電防止のため、漏電ブレーカーを有するコンセント盤に接続するか、漏電ブレーカーを装備すること。
3.1.3.　ラック
・インターロック等の誤作動を防止するため、電力系・駆動系と信号系の配線を分けて配置すること。
・制御装置等は１９インチラック（EIA 規格に準拠）に設置し、ラック自身は転倒防止策を講じること。そのほかの規格品に設置する可能性が生じた場合は、事前に担当者と協議すること。
・ミリサイズ規格の機器を設置する場合は、変換金具を使用して設置すること。
3.1.4.　ステッピングモータ
3.1.4.1.　駆動方式
・5 本結線、原則としてペンタゴン結線による駆動方式を使用すること。配線等の詳しい内容については、専用のマニュアルを参考にすること。
3.1.4.2.　センサ
・センサは原則として 2 個（3 線）と 5 個（7 線）の 2 タイプを使用すること。
3.1.4.3.　リミットスイッチ
・原則としてリミットスイッチを両端点に設けること。
・リミットスイッチの位置は、調整可能とすること。ただし、納入時には設定されたリミット位置を再現できるようにマーカー等で印をつけること。
・原則としてリミットスイッチに加え、万一暴走した場合でも、真空内の光学素子やスリットのブレードに負担をかけることがないように、真空外でメカニカルストッパを設けておくこと。これは二重の安全保護を施すことを意味する。
・リミットスイッチは原則として B 接点（接点を Make したら Open になる）、原点センサは A 接点とすること。
3.1.4.4.　コネクタ
・ステッピングモータとドライバとの間のコネクタは、原則としてスリオ社の丸形コネクタ G シリーズ、トリムトリオバンダムを使用すること。
・電源供給側は原則として、ソケットコンタクト、受け側はピンコンタクトを使用すること。
・ドライバとコントローラとの間のコネクタは、原則として Dsub9 を使用すること。
3.1.4.5.　ケーブル

・原則としてモータのパワーラインとリミットスイッチのケーブルはシールド線によって分離すること。コネクタ部のケーブルは共通にすること。

3.1.4.6. モータの回転方向

・被駆動機器が放射光光軸近傍に設置され、直線方向に（回転ではない）駆動される場合、コントローラから CW 方向の駆動信号を受けた場合には、以下の方向に機器が駆動するようにハードウェアを構成すること。

- 光軸に対して上下方向の場合：上方向
- 光軸に対して左右方向の場合：光を背負って左方向（光に正対して右方向）
- 光軸に平行方向の場合：光の進行方向

3.1.5. コンピュータ

・納品物としてコンピュータ等が含まれる場合は、あらかじめウィルス対策を講じること。

3.2. 配管

3.2.1. 継手

・食い込み継ぎ手が指定された場合は、原則としてフジキン社製 2 圧縮リング方式継手（ミリサイズ規格）あるいはスウェジロック社製スウェジロック（JIS 規格）を使用することとする。ただし異なる製造元の継手同士を同一箇所で接続してはならない。

・材質は原則としてステンレスとする。ただし、水導入フランジ部など指定箇所においては、テフロン製を指定する場合がある。

・往路・復路は、指定箇所に対して矢印等で明示すること。

3.2.2. 冷却水配管

・施設側冷却水は抵抗率 1.0MΩ・cm 以上の純水である。工事中、完成後を問わずこの基準値以下の水を戻してはならない。

・真空内において表面が晒される配管は、脱ガス特性が明らかな金属性であることを原則とする。

・真空内の機器の冷却水配管は、一筆書きとする。

・真空外機器に関しては、協議の上、フレキシブルチューブや継手を認める場合がある。配管の外径は原則として ϕ10mm とする。

・配管の色は、往路青色、復路緑色とする。金属配管を用いる場合は、継手接続部分に往路青色、復路緑色の目印をつけること。

・冷却水配管に漏洩がないことを確認するため、窒素ガスや専用の漏洩検査液を用いた加圧漏洩試験（0.6MPa）を行うこと。

3.2.3. 圧空配管

・圧空配管は外径 ϕ6mm を原則とし、色は黄色とする。

・シンフレックスチューブが指定された場合でも、金属配管を排他するものではない。この場合は、保守が容易なように、最終段にシンフレックスチューブもしくはフレキシブルチュ

ーブを用いること。
・圧空配管に漏洩がないことを確認するため、窒素ガスや専用の漏洩検査液を用いて加圧試験（耐圧:0.85MPa）を行うこと。また、全ての配管終了後に漏洩試験（圧力：0.5MPa）を実施し、1 時間保持で減圧が 5 %以下であることを確認すること。

3.3.　機械
3.3.1.　ネジ
・ボルト、ナット等の部品においては原則として JIS 規格（ミリサイズ）を用いること。インチサイズを用いる場合、あらかじめ担当者の承認を得ること。
3.3.2.　架台
3.3.2.1.　精度
・粗調整と微調整可能な位置調整機構を有すること。
3.3.2.2.　剛性
・各軸所定の精度、再現性を十分満たす剛性を持った構造とすること。ベーキングによって位置変位、変形しない構造であること。
・調整終了後は、粗調機構ならびに微調機構は十分な剛性・強度で固定できるものとすること。
・排気装置本体およびミラー調整機構などのメンテナンスの必要な重量物が容易に取り外し可能な構造とし、必要ならばそのための治具を有すること。
3.3.2.3.　固定方法
・架台は床面に十分な強度でアンカー固定できる構造であること。
・水平方向は 0.5 G、垂直方向は 1.5 G の揺れに対して転倒しないよう、機器の重心なども考慮し適切にアンカー固定すること。
3.3.2.4.　移動
・架台は機器自身で自走できるようなキャスターを設けるか、ハンドパレットなどの搬送機器を用いて移動することができるよう、架台と床面との間に 70 mm 以上 150 mm 以下の隙間をあけ、搬送機器が架台下部に入る構造にすること。
3.3.3.　位置決め精度
3.3.3.1.　最小移動量（最小可変量）
・パルスモータにより電動駆動する場合、ハーフパルスの移動量を明示すること。
3.3.3.2.　最小読取量
・目視読取（目盛など）の場合、副尺などによる目盛りを用いる場合はその旨を明示すること。
3.3.3.3.　累積リード誤差
・基準点から一方向に一定間隔で順次位置決めを行い、それぞれの位置決め地点での測定値と指令値との差をテーブルの移動範囲で測定し、その差分の最大差を累積リード誤差とす

る。

3.3.3.4. ロストモーション

・駆動部品と駆動ギアとの間に生じる隙間が原因で生じるバックラッシュなどが原因で生じるロストモーションは、次のように定義する。任意の位置に対して、正の向き（モータ回転 CW 方向）から位置決めし、その位置を測定する。さらに正の向きに移動させた後、負の向き（モータ回転 CCW 方向）に同量の指令を与え移動させて位置決めし、その位置を測定する。さらに負の向きに移動させた後、正の向きに同量の指令を与え、移動させて位置決めし、その位置を測定する。この位置決め測定を、正の向き・負の向きそれぞれ複数回行い、停止位置の平均値の差を求めた最大値とする。

3.3.3.5. 再現性（繰り返し位置決め精度）

・同じ方向からの任意の一点（基準とする測定点）に位置決めし、その位置を測定する。この測定点に対して複数回の測定を行い、その最大差を求める。この操作を所定の位置で行い、求めた値の最大値の 1/2 に±を付けた値を、繰り返し位置精度とする。

3.3.3.6. 真直度

・基準位置から一方向に順次位置決めを行い、それぞれの位置での垂直方向、水平方向の変位長さと基準位置との差を測定し、測定値の始点・終点を結んだ直線から変位の最大差を真直度とする。

3.3.3.7. 円周振れ

・データム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した位置又は任意の位置で指定した方向に変位する大きさ部品を回転させたときの任意の円周の一部の振れのこととする。

・回転軸に垂直な変位計で指定した部分の変位量を測定することで求めることとする。

3.3.3.8. 偏心（同心度）

・部品の中心と同一中心上にあるべき点の部品の円中心からのずれの大きさのこととする。

・テーブルを 1 回転させ、回転軸の水平方向の変位を測定し、その測定値の最大差を偏心とする。

3.3.3.9. 面振れ

・テーブルを 1 回転させ、上面の外周付近で上下方向の変位を測定し、その最大差を面振れとする。

3.4. 真空

3.4.1. 真空度

・真空度の計測はポンプ内部など意図的な好条件における計測は認めない。

3.4.2. 真空機器内の部品類

・真空機器内で使用する部品類は真空内で放出ガスの少ない材料を用いること。必要に応じて、脱脂及び電解研磨などの処置を施すこと。

3.4.3. リークチェック

・リークチェックを行った場合は、その方法を事前に協議し担当者の承認を得ること。リークチェックを行う場合は測定機器、温度、湿度などの条件を記録すること。

3.4.4. 真空配管

・NW、 ICF ミラーおよび調整機構取付用フランジは ICF 規格フランジと同等以上のメタルシールであれば採用を認める。なお、ICF 規格以外のメタルシールを用いる場合は、製造メーカー名、連絡先、型番、形状、材質等を明示し、入手方法を明らかにすること。

・取付用フランジのメタルシールが ICF 規格でない場合、粗引き用にバイトンの O リングもしくは角リングを添付すること。

3.4.5. 真空ポンプ

3.4.5.1. ロータリーポンプ、スクロールポンプの使用

・本施設内では、ロータリーポンプやスクロールポンプの使用を推奨しない。

3.4.5.2. 振動対策

・駆動部分のある真空ポンプを使用する場合は他の機器に振動などの影響を与えることを抑えるために、除震などの対策を講じること。

3.4.6. ベーキング

・目標とする真空度を達成するためにベーキングを行う必要がある場合は、以下の要件を満たすこと。

- リボンヒータを用いる場合は、AC200V 用とする。
- リボンヒータは、指定の標準のコネクタを取り付けること。
- リボンヒータ専用の端子台を取り付け、上記のコネクタの中継に使用すること。
- シースヒータを用いる場合は、電圧を明示し、系統ごとに同一電圧印加で制御できるように配線を工夫すること。
- ベーキング時には、シースヒータ、リボンヒータを問わず、真空セクションごとに指定する標準ベーキングコントローラとベーキング用コネクタのみにより取り合いできる構成とすること。
- ベーキングヒータを巻いた場合には、通線・絶縁試験を行うこと。
- ベーキングに関わる詳細については、別途用意する「ビームライン・ベーキング要領」に従うこと。

3.5. 制御

3.5.1. 開発環境

・制御系の開発環境として、以下の環境を推奨する。

3.5.1.1. OS

・Windows の場合

バージョンおよびエディション：Windows 10 Pro

追加パッケージ：適宜

・Linux の場合

ディストリビューション：Red Hat Enterprise Linux または互換 OS

バージョン：8 以上

追加パッケージ：適宜

3.5.1.2. コンパイラ

・コンパイラ：Visual Studio 2019、gcc、g++

・バージョン：適宜

・スクリプト言語

・言語：Python 推奨

・バージョン：3.6 以降

3.5.2. 通信規格

3.5.2.1. プロセス間通信

・プロトコル：MQTT（Message Queueing Telemetry Transport）

・バージョン：適宜

3.5.2.2. 機器通信

・Ethernet 推奨←加速器制御 EtherCAT（https://www.ethercat.org/jp.htm）

3.5.3. 通線

3.5.3.1. ケーブル

・配線工事はすべて端子台またはコネクタにより取り合う。ケーブルには別途定める命名規則に乗っ取ったタグを付けること。

3.5.3.2. 端子台、コネクタ

・タグ（名称シール）を付けること。

3.5.4. 19 インチラック

3.5.4.1. 扉

・扉を備える場合は、前面は鍵付きの透明な扉とすること、後面の扉は底面より 32cm 上部からの開閉式とする。

3.5.4.2. 側面および底面

・側面板は取り外し可能なものとし、ケーブルダクトは可能な限り底面に配置すること。

3.5.4.3. コンセント

・遮断機を備えること。アース端子、ロック機能を備えること。

3.5.4.4. 空冷ファン

・必要な場合、内部機器の盤内消費電力を考慮した空冷用ファンを備えること。

3.5.5. 操作パネルの配色

・JISZ9101：図記号－安全色及び安全標識－安全標識及び安全マーキングのデザイン通則に従うこと。

3.5.6.　アラーム

・警報音は JISS0013：規格名称「高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品」の報知音に従うこと。

4.　作業等

4.1.　品質管理

・本設備の制作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。

- 管理体制
- 設計管理
- 現地作業管理
- 材料管理
- 工程管理
- 試験・検査管理
- 不適合管理
- 記録の保管・重要度分類
- 監査

4.2.　現場作業の工程管理

・施工工程を発注担当者の指定する期間で管理し、実績及び予定を報告すること。

・長期の施工工程については作業内容毎に予定を立て、予め報告すること。

4.3.　作業報告

・作業進捗状況に遅れが生じている場合は、速やかに担当者に報告すること。

・作業日誌をＡ４用紙１枚等にまとめ現場責任者名において毎日報告すること。当日中であれば電子メール等での報告でもよい。

・日誌には、少なくとも立入業者名、作業内容、進捗状況、事故の有無が記載されていること。

4.4.　機密保持

・受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。

4.5.　安全管理等

4.5.1.　一般事項

・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策 等の準備を行い、

作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。

・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。

・受注者は、作業着手に先立ち担当者と安全について十分に打合せを行った後着手すること。

・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。

・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。

・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。

4.5.2. 現地作業

・現地作業を実施する場合は、事前に作業工程表を提出して確認を得ること。

・工事用仮設建物を設置する場合には、予め所定の部署と連絡をとり指示を仰ぐこと。

・作業責任者をおき、発注者の所属する機関における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。

・作業は、発注者の所属する機関の勤務時間内に実施すること。ただし、緊急を要し担当が承諾した場合は、所定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。

・他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく担当者に報告し、その指示に従って 速やかに現状に復すること。

・作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。

・構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、所定の手続きを遵守すること。

・現場作業責任者は作業者がいる間は常に担当者と連絡がとれるようにしていること。担当者の指示に従って連絡手段を講じること。

・高所作業に当たっては所定の安全ベルト・ヘルメットを着用し、専用の階段あるいは足場を使うこと。

・万一、事故が発生した場合には人的安全措置を取り、速やかに担当者に連絡をとること。事故報告書を作成の上、発生日の翌日中に提出すること。

・作業は必ず現場作業管理者の管理のもと複数人で行うこと。

4.5.3. 梱包・輸送

・製品を傷つけないように、適切に梱包・輸送すること。

・真空チェンバには、輸送用フランジを取り付け、内部を超高純度窒素で充填する、外面を清浄なポリエチレン袋で密封し、袋内に脱酸素剤を入れるなどの処理を行い、据え付けまでの保管中に損傷、汚染、腐食、さびなどが発生しないように梱包すること。

4.5.4. 搬入

・実験ホール内へは、表２のような搬入口が利用可能である。それぞれの搬入口に侵入可能

なトラックも併せて別表に示しているので参考にすること。
・搬入・搬出作業予定は、事前に担当者と日程調整等を行うこと。
・原則として土日、休日、早朝、夜間の搬入は避けること。
・人力のみで移動できない物品の搬入にあたっては、搬入計画を事前に提出すること。
・搬入時には雰囲気の清浄性を保持するため、床・壁・雰囲気保護のための措置を講じること。
・梱包材等廃棄物はすべて持ち帰り、適正な処分を行うこと。
・環境対応物品を極力用い、梱包材などは性能に支障を来たさない範囲で再利用を積極的に推し進めること。
・産業廃棄物を処理した場合には、マニフェスト制度に則り適正に処理したことが確認できるようマニフェスト伝票を提出するよう求める場合がある。

4.5.5. クレーン及びフォークリフト等重機類

・本施設にはフォークリフトは整備されていない。そのことに留意して搬入計画等を立てること。
・実験ホールには耐荷重 2.8 t、揚程 7.0 mの床上クレーンがある。このクレーンの長期間にわたる専有は不可能である。使用する場合には事前に使用計画書を提出し担当者の指示に従うこと。
・実験ホールにフォークリフト等の重機を持ち込む場合は担当者の許可を取り原則として電動式とすること。
・フォークリフト等を使用する場合は、所謂白タイヤを使用するなどして床面を汚さぬこと。
・クレーン操作ならびに玉掛作業などにあたっては安全ヘルメットを着用の上、十二分に作業に精通した所定の法的免許保有者・有資格者が行うこと。
・クレーンやフォークリフトによって人を吊ったり足場としたりしてはならない。

4.5.6. 養生

・周辺に設置されている機器への粉塵・漏水等がなきよう防護策を講じること。
・隣接するビームライン及び搬入経路にあたるビームラインや実験ホールに騒音、粉塵、臭いなどの影響を与えないように極力留意して作業すること。万一、どうしてもこれらを避け得ないと予想される場合には、実施期間、現場責任者名、連絡先を明記した立て看板を現場に設置し、周知を図ること。
・実験ホール内に持ち込むシート等は防炎性のものを用いること。
・作業に必要な工具、用具などは施工業者によって準備すること。

4.5.7. 溶接及びグラインダー等作業

・現場での溶接、グラインダー作業、などは極力避ける設計とすること。止むを得ずこれらの作業を行う場合は、理由を付して担当者に届け出た後、周囲の雰囲気を汚さない措置を必ず講ずること。

・原則として全方向を囲う蔽いを用いること。

4.5.8. はつり作業

・粉塵、騒音などの防止に十分考慮すること。

・全方向を囲う蔽い内で十分な散水を行いながら作業し、蔽い外への排気は防塵フィルターを通して行うこと。

・ペンキ等の可燃物の管理を注意深く行い、溶接火花等を含む火気を近づけないこと。

4.5.9. 感染症対策

・現地で作業を行う作業員は、十分な感染症対策を行い、体調が不良のものは基本的に作業を行ってはならない。

4.5.10. 常時電源接続機器

・常時電源接続機器の運転を行う場合は、事前に担当者に機器と運転期間を協議し担当者の承認を得るともに、機器の付近に運転期間と連絡先を掲示すること。

4.5.11. 接続試験

・通電、通水などの接続試験は、担当者立会いの下行うこと。試験に合格しない場合は規定を満たすように対処すること。

・通水前は、フラッシング処理を行うこと。+

表２：搬入口

搬入口の名称	クレーンのサイズ	シャッターのサイズ	搬入可能なトラック
外周搬入室 （北東部）	耐荷重：2.8t 揚程：5.0m	W3500mm、 H4100mm	全長13m、全幅2.5m、全高3.8m
実験ホール用搬入組 立調整室（南西部）	耐荷重：20t 揚程：6.88m	W6100mm、 H4100mm	全長15m、全幅3m、全高3.8m 積載16tのトレーラー

知的財産権特約条項

（知的財産権等の定義）

第１条　この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一　特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利（以下総称して「産業財産権等」という。）

二　特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利

三　著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。）及び外国における著作権に相当する権利（以下総称して「著作権」という。）

四　前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利

２　この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一　特許権の対象となるものについてはその発明

二　実用新案権の対象となるものについてはその考案

三　意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出

３　この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第２条第５項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属）

第２条　甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

一　乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。

二　乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

三　乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

四　乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権（仮専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾（以下「専用実施権等の設定等」という。）をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。

イ　子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

ロ　承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成10年法律第52号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ（同法第11条第１項の認定を受けた者）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

ハ　乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合

２　乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。

３　乙は、第１項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

（知的財産権の報告）

第３条　前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。

２　乙は、産業技術力強化法（平成12年法律第44号）第17条第１項に規定する特定研

究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）、実用新案法施行規則（昭和35年通商産業省令第11号）及び意匠法施行規則（昭和35年通商産業省令第12号）等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。

3　乙は、第１項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内（ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

4　乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき（ただし、第５条第４項に規定する場合を除く。）は、実施等した日から60日以内（ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5　乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転）

第４条　乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合（本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。）には、第２条から第６条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

2　乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第２条第１項第４号イからハまでに定める場合には、この限りでない。

3　乙は、第１項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場合に限る。）である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。

4　乙は、第１項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内（ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5　乙が第１項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第２条第１項各号及び第３項並びに第３条から第６条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾）

第５条　乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第２条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

2　乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第２条第１項第４号イからハまでに定める場合は、この限りではない。

3　乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場合に限る。）である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。

4　乙は、第２項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内（ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5　甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が　甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄）

第６条　乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属）

第７条　甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。

一　乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

二　乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。

2　前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。

3　乙は、第１項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転）

第８条　甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾）

第９条　甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施）

第10条　甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。

２　乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄）

第11条　甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

（著作権の帰属）

第12条　第２条第１項及び第７条第１項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。

２　乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。

３　乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。

（合併等又は買収の場合の報告等）

第13条　乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合（乙の親会社が変更した場合を含む。第３項第１号において同じ。）は、甲に対しその旨速やかに報告し

なければならない。

2　前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。

3　乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。

一　合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。

二　前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。

三　移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。

（秘密の保持）

第14条　甲及び乙は、第２条及び第７条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。

（委任・下請負）

第15条　乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。

2　乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

（協議）

第16条　第２条及び第７条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第17条　本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

以上